

特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第5824774号

(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

ガンマ量子反応の位置及び時間を測定するスト
リップ装置と方法及び陽電子放射断層撮影にお
いてガンマ量子反応の位置及び時間を測定する
その他別紙記載

特許権者
(PATENTEE)

ポーランド国 クラクフ ピーエル-31-0
07、ユーエル、グレビア 24
国籍 ポーランド共和国
ユニバーシテット ヤギエロンスキ

発明者
(INVENTOR)

モスカル、 パウエル

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2012-520560

出願日
(FILING DATE)

平成22年 7月16日(July 16, 2010)

登録日
(REGISTRATION DATE)

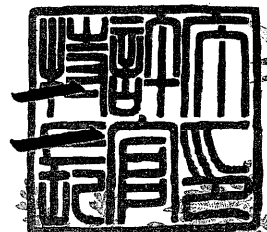
平成27年10月23日(October 23, 2015)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成27年10月23日(October 23, 2015)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

伊藤 伊



特許証

(CERTIFICATE OF PATENT)

(続葉 1)

特許第5824774号 (PATENT NUMBER)

特願2012-520560 (APPLICATION NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

ストリップ装置の使用方法

[以下余白]